

台湾 TOPTECH 气压控制金相研磨抛光机 --P25FS-1-R5



设备描述:本机为采用气压控制供给压力，具备单轴独立加压系统及中心整体加压系统的双模式半自动磨抛机，透过快速更换夹具可实现对各种形状及尺寸的试样进行制备，采用独立加压时可以实现对每一个试样供给恒定的压力，使制样达到最佳的效果，并带有条件记忆模块，可以将磨抛过程程序化，是磨抛机中的最佳选择。

特点:

- *中心加压及独立加压双模式控制
- *多彩触控屏幕操作，可记忆操作条件(时间，转速)
- *支持磁性快速换盘系统
- *快拆式治具可及时更换治具以适应不同工件
- *超大型支撑底座确保操作时的平衡性
- *防漏及自动清洗设计确保机器的使用寿命，轴承包用 5 年以上

规格:

- 研磨盘数：1 个
- 研磨盘径：P25 Φ 250mm
- 研磨转速：底盘50-600rpm，模头 80 rpm
- 研磨马力：1HP
- 机台型式:桌上型
- 机台身：FRP 高强度FRP外壳, 防锈耐腐蚀
- 试片研磨数：采独立加压标准镶嵌试样夹具时为1-5个，



镶嵌试片尺寸: 提供 Φ 40mm 镶嵌试样夹具

输入气压压力: 2.3~8KG/cm²

研磨头加压方式: 可选择中心加压或单独加压

操作界面: LCD 彩色触控荧屏, 可设定研磨转速, 时间, 转向、水槽清洗功能

运转中提示: 1. 运转转速 2. 时间倒数计时 3. 操控功能

中心加压力量调整范围: Max: 6~25kg

单独加压力量调整范围: 1~6kg

记忆功能: 记忆---研磨转速 . 时间. 可记忆模组功能100组

旋转方向: 研磨盘及研磨头转向皆可调整

电源: AC220V 1 Φ

机台尺寸: 580*920*750mm

机台重量: 110kg

二、配置

项目	名称	描述	数量
1.	P25FS-1-R5 主机	220V 单相电源	1 台
2.	40mm 镶嵌件用治具盘三孔式	R5 型使用	1 个
3.	平面盘	250mm, 表面带磁性	1 个
4.	防粘盘	抛光布及背胶砂纸转换用	
5.	250mm 金刚石研磨盘	Pl1a2, 第一道研磨用	
6.	250mm 金刚石研磨盘	Pl1a3, 第二道研磨用	
7.	抛光布 2TS6	250mm, 3u 金刚石用	
8.	抛光布 4FV2	250mm 1u 金刚石用	
9.	单晶悬浮液	3u 250ml/瓶	
10.	单晶悬浮液	1u 250ml/瓶	